

COPY

校正機関

認定証

認定番号 RCL00590

機 関 名 称 : 株式会社エビデント
顕微鏡校正ラボトリ

所 在 地 : 東京都八王子市高倉町 67-4

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに校正機関として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 幾何学量 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2027 年 4 月 30 日

改定日 2025 年 6 月 28 日

初回認定日 2023 年 4 月 4 日

公益財団法人

日本適合性認定協会

理事長

三木幸信

三木幸信

管理番号 : RCL00590-20250628

COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(1/3頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ
機関所在地	東京都八王子市高倉町 67-4

1) 校正を実施する事業所

事業所名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ 本社
〒	192-0033
所在地	東京都八王子市高倉町 67-4
恒久的施設で行う校正か、 現地校正かの別	<input type="checkbox"/> 恒久的施設で行う校正 <input checked="" type="checkbox"/> 現地校正

1) 校正を実施する事業所

事業所名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ 大阪支店
〒	530-6031
所在地	大阪府大阪市北区天満橋 1-8-30 OAP タワー
恒久的施設で行う校正か、 現地校正かの別	<input type="checkbox"/> 恒久的施設で行う校正 <input checked="" type="checkbox"/> 現地校正

認定範囲

分類コード 測定対象量/ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ ¹⁾	校正手順書・ 備考
M13.22 三次元測定機 M13.22.4 デジタルマイクロスコ ープ 器差	XY 平面について 10000 μm 以内 (視野サイズ) 校正対象の対物レンズの種類： 1× 1.25× 2.5× 3× 5× 10× 20× 40× 50×	2.9%	K-OIS Z12020 (所内手順書) 校正対象機種は DSX シリーズと する。

COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(2/3頁)



試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ
機関所在地	東京都八王子市高倉町 67-4

分類コード 測定対象量/ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ ¹⁾	校正手順書・ 備考
M13.22 三次元測定機 M13.22.5 レーザー顕微鏡 器差	XY 平面について 961.5 μm 以内 (視野サイズの中心 75%領域) 校正対象の対物レンズの種類： 10× 20× 50× 100× Z 軸について 1 μm 以内 観察視野を平面方向に貼り合わせ た合成画像における X、Y 軸につ いて 10000 μm 以内 観察視野を平面方向に貼り合わせ た合成画像における Z 軸につ いて 300 μm 以内	1.0 % 0.11 μm 対物レンズ 10× : 18 μm 対物レンズ 20× : 9.4 μm 1.9 μm	K-OIS Z12010 (所内手順書) 校正対象機種は OLS シリーズと する。
¹⁾ 包含係数に関する情報	<input checked="" type="checkbox"/> 信頼の水準約 95%, $k=2$ <input type="checkbox"/> t 分布に基づき求めた有効自由度に応じた包含係数であり、95% の信頼の水準をもつと推定される区間を与える。 <input type="checkbox"/> その他 ()		

COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(3/3頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ
機関所在地	東京都八王子市高倉町 67-4

【認定証に係る注記】

- 1)この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 2)年号及び又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。

公益財団法人
日本適合性認定協会